

Uchwała nr 251/XLVIII/2015  
Senatu Politechniki Warszawskiej  
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aparatury badawczej do Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

§ 1

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 45 ust. 3 pkt 6 lit. a oraz § 129 Statutu PW w zw. z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), wyraża zgodę na nabycie następującej aparatury badawczej, o wartości przekraczającej 1 mln zł, na potrzeby powstających w Laboratorium Centralnym CEZAMAT pracowni, z projektu „Fotonika i Technologie Terahercowe – Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.02.01.00-14 197/09):

1. System do PECVD dedykowany do tlenko-azotków;
2. System do nanoszenia warstw metalicznych – magnetron;
3. System do mokrego trawienia Al na płytkach 150 i 200 mm metodą natryskową;
4. System do mokrego trawienia SiO<sub>2</sub> na płytkach 150 i 200 mm metodą natryskową;
5. Stanowisko do anizotropowego trawienia krzemu w KOH lub TMAH na płytce od 100 mm do 200 mm;
6. Zestaw urządzeń do procesów fotolitograficznych, na który składają się:
  - a. System do ręcznego centrowania i naświetlania płytek od 100 mm do 200 mm z możliwością BSA;
  - b. Wirówka do nanoszenia emulsji na płytki do 100 mm;
  - c. Wirówka do wywoływania emulsji na płytkach do 100 mm;
  - d. Wirówka do suszenia płytek do 100 mm;
  - e. Hot plate do wstępnego suszenia emulsji na płytkach do 100 mm;
  - f. Hot plate do hartowania emulsji na płytkach do 100 mm;
  - g. System do czyszczenia masek fotolitograficznych;
  - h. Dedykowane tracki do obróbki emulsji;
  - i. Zestaw do usuwania emulsji na mokro;
  - j. Dygestorium/wet bench do ręcznego wywoływania/płukania/obróbki emulsji.

7. Mikroskop SEM do pomiarów CD i obserwacji jakości odwzorowania w skali nanometrowej wraz z kompatybilnym mikroskopem do kontroli CD i jakości odwzorowania kształtów na płytce do 200 mm;
8. Urządzenie do centrowania i naświetlania wiązką elektronową (elektronolitografia).


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Senatu

  
mgr Beata Dobrzeńska

Rektor

  
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt